

2020年 第67回応用物理学会春季講演会 シンポジウム(T-15)

# EUV・軟X線イメージングの描く未来

3月14日(土)13時30分から 上智大学四谷キャンパス(千代田区)

進歩が緩やかであった極紫外(EUV)・軟X線イメージングの世界は、微細加工技術やPCの計算能力等の要素技術の進歩と、先進的なユーザーによる先駆的応用により、ここ数年急速にユーザーを増やしつつある。本企画では、要素・装置開発者とユーザーが同平面上でイメージング技術を議論し、関連コミュニティを活性化することを目的とする。

## — 主な招待講演 — (予定: 敬称略)

「EUVリソグラフィ用マスク検査顕微鏡の開発」  
武久 究(レーザーテック)

「コヒーレント軟X線回折による磁気イメージングの現状と展望」  
山崎 裕一(NIMS)

「X線顕微分析を用いて火星隕石から火星の水情報を引き出す」  
菅 大暉(東大)

「軟X線を用いたリチウムイオン電池の顕微・オペランド分光」  
細野 英司(産総研)

「アンジュレータ放射の空間構造とその応用の可能性」  
加藤 政博(広島大)

「軟X線・EUV用CMOSイメージセンサの開発」  
寺西 信一(兵庫県立大)

## 一般講演も募集しています。

EUV・軟X線域の要素技術・利用研究に加えて、ユーザーからの期待・将来展望の観点からの講演も歓迎いたします。

ポリマーブレンド(PS/PMMA)のEUV透過像

世話人

豊田 光紀(東京工芸大)、大東 琢治(分子研)、原田 哲男(兵庫県立大)

問合せ先

Email: m.toyoda@mega.t-kougei.ac.jp , Tel: 046(242)9511